

レーザー学会第 502 回研究会
「短波長・短パルス量子ビーム発生と応用」のご案内

日時:2016 年 12 月 15 日(木)、16 日(金)
場所:山形県天童市 ほほえみの宿 滝の湯
(〒994-0025 山形県天童市鎌田本町 1-1-30)
Tel 023-654-2211 Fax 023-654-2217
URL: <http://www.takinoyu.com/access/>
交通:JR天童駅(山形新幹線)から徒歩 15 分、
または山形空港から車で 20 分
(送迎バス手配予定)



内容:紫外から X 線領域における光源開発および短パルス粒子線・電子線・中性子線発生の科学とその応用。

参加費(研究会報告付き):

会員:2,000 円;非会員 3,000 円;
学生会員:1,000 円;学生非会員:1,500 円(学生の聴講のみは無料)
当日受付にてお支払いください。なお、宿泊費等は別途徴収いたします。
宿泊の詳細は現地世話人(東北大・大西)までお問い合わせください。
研究会報告単品購入 1 部 2,000 円(当日価格, 税込)

同時主催:レーザー励起 X 線源とその応用研究会

担当委員:余語 覚文(大阪大学)

E-mail: yogo-a@ile.osaka-u.ac.jp

TEL: 06-6879-8760

現地世話人(レーザー励起 X 線源とその応用研究会):大西 直文(東北大学)

E-mail: ohnishi@rhd.mech.tohoku.ac.jp

TEL: 022-795-6919

プログラム:

1) 高フルエンス EUV 光による材料表面改質

田中のぞみ、安田清和¹、出口 亮、和田 直、余語覚文、西村博明
(大阪大学レーザーエネルギー学研究センター、¹大阪大学工学研究科)

2) 高強度 EUV 光アブレーションプラームの診断

出口 亮、田中のぞみ、和田 直、砂原 淳¹、村上匡且、余語覚文、西村博明
(大阪大学レーザーエネルギー学研究センター、¹(公財)レーザー技術総合研究所)

3) EUV アブレーション系における不純物抑制

和田 直、田中のぞみ、出口 亮、余語覚文、西村博明
(大阪大学レーザーエネルギー学研究センター)

4) レーザー励起 EUV 光源最適化に向けたプラズマ駆動レーザーの吸収測定

松隈 啓、鈴木洋介、細田達矢、藤岡慎介、余語覚文、西村博明
(大阪大学レーザーエネルギー学研究センター)

一般社団法人レーザー学会
多くのご来聴をお待ちしております